

F37

薄膜厚度测量仪



Filmetrics 优势

- 嵌入式在线诊断
- 免费离线分析软件
- 精细的历史数据功能，帮助用户有效的存储，重现与绘制测量结果

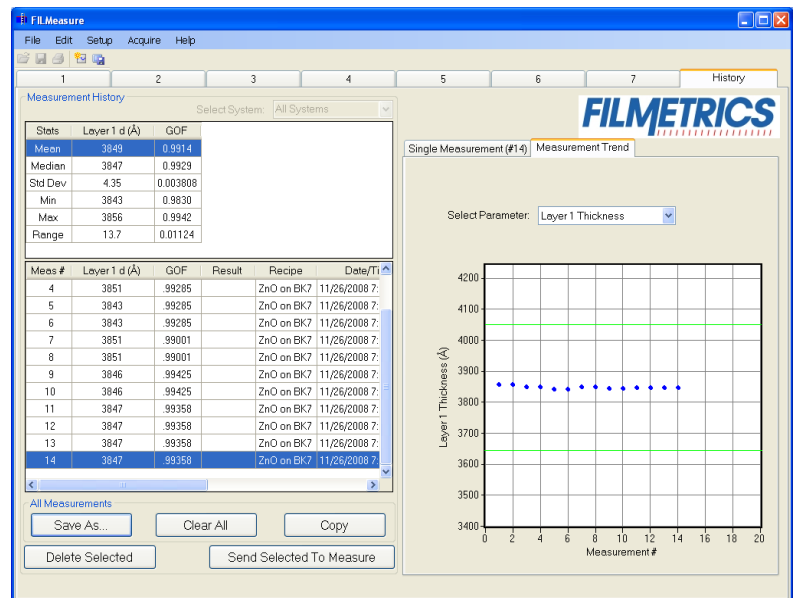
免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以在网络上在线看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！

附带的软件和 USB 连接界面使 F37 易于安装到任何 Windows 平台的 PC，功能强大的软件预配了超过百种材料的光学参数，这有助于多种不同膜层结构的测量，不论是单层、多层堆叠，甚至是单一纯物质，用户能轻易地从资料库中找到适用的模型以进行测量分析。如果是没有预配的材料，用户只要将所知的材料光学参数直接导入资料库，或者经由测量，把所得的光学数据储存，即可使用。

多点测量系统，单一机台最多可搭配七组光谱仪

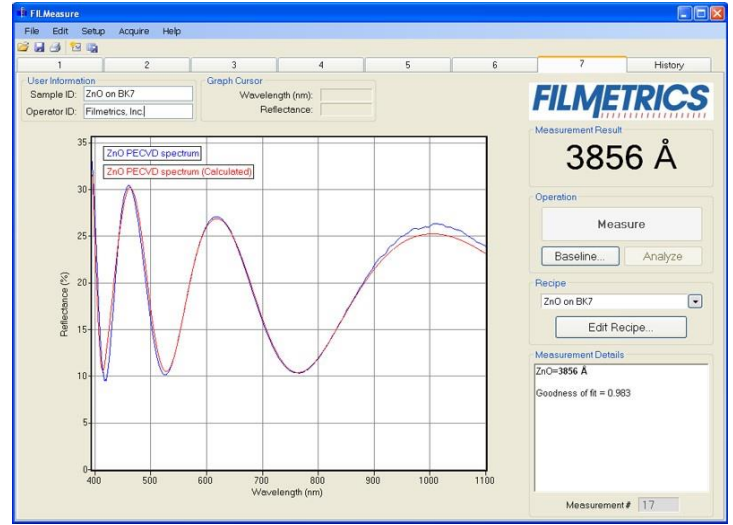
高性价比的 F37 机型因配置了先进的光谱测量系统，能够迅速快捷的应用于工业生产中在线测量膜层的厚度，及光学常数（ n 、 k 值），通过对待测膜层上下表面的反射光谱的分析就能够在数秒内获得厚度、折射率及消光系数。



F37 先进的光谱测量系统，采用标准 19 英寸的机架式工业机箱，最多能配置 7 个独立的光谱仪。F37 测量软件也可被主机通过数字化 I/O 软件控制来进行测量。测量数据能够自动输出到主机供 SPC 控制。此外，为了满足不同测量环境需求，Filmetrics 也可以提供多样化的透镜配件及光学探头夹具供用户选择使用。

F37

薄膜厚度测量仪



	SPEC-2-UV	SPEC-2	SPEC-2-NIR	SPEC-2-XT	SPEC-2-XXT
厚度测量范围*:	3 nm-40 μm	15 nm-70 μm	100 nm-250 μm	0.2 μm-450 μm	10 μm-1 mm
测量 n 和 k 值得厚度要求*:	50 nm	100 nm	500 nm	2 μm	100 μm
精度*: 大于 0.4%或	1 nm	2 nm	3 nm	5 nm	5 nm
精度 ¹ :	0.1 nm	0.1 nm	0.2 nm	1 nm	1 nm
稳定性 ² :	0.07 nm	0.07 nm	0.12 nm	1 nm	1 nm
斑点尺寸:	标准 1.5 毫米				25 μm
样品尺寸:	直径从 1 毫米到 300 毫米				
光源:	氙灯 钨卤素灯	钨卤素灯			1550 nm SLED
光谱仪					
波长范围:	200-1100 nm	380-1050 nm	950-1700 nm	1440-1690 nm	1520-1690 nm

基本要求

电源: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6-0.3 A

电脑要求

接口: USB 2.0

认证: CE EMC 和欧洲安全指令

操作系统

PC: Windows XP(SP2) - Windows 8(64-bit)

Mac: OS X Lion/Mountain

提供定制化的波长组合

* 取决于材料

¹ 标准偏差为一天内在 Si 基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值的标准偏差。该值为连续 20 天测量的标准偏差值的平均值。

² 2σ 是基于连续 20 天，每天在基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值上得出。



优尼康科技有限公司

– Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc

